## 06;07 Рекомбинационно-стимулированный рост дислокационной петли в полупроводнике при интенсивной лазерной накачке электрон-дырочных пар

## © В.И. Емельянов, А.В. Рогачева

Международный лазерный центр Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва E-mail: emel@em.msk.ru

## Поступило в Редакцию 19 декабря 2001 г.

Предложен механизм рекомбинационно-стимулированного роста спаренного междоузельно-вакансионного диска в полупроводнике, в котором происходят интенсивная генерация и локализация электрон-дырочных пар. Получено выражение для скорости роста дислокационной петли как функции интенсивности лазерного излучения и температуры среды.

1. Обычно для описания лазерного индуцирования дислокаций привлекается механизм образования их за счет действия сдвиговой деформации, возникающей при пространственно-неоднородном лазерном нагреве среды [1].

В настоящей работе мы рассматриваем новый механизм спонтанного роста дислокационной петли в полупроводнике при наличии высокой концентрации электрон-дырочных пар, генерируемых лазерным излучением. Рост петли по этому механизму происходит за счет энергии рекомбинации локализованных электрон-дырочных пар. Такой механизм роста дислокационной петли в поле лазерного излучения можно, по аналогии с механизмом лазерно-индуцированной генерации точечных дефектов [2–4], назвать рекомбинационно-стимулированным.

2. Пусть в полупроводнике, в котором интенсивная лазерная накачка создает электрон-дырочные пары, имеется затравочный дефект. Локализация и последующая рекомбинация электрон-дырочной пары вблизи этого затравочного дефекта сопровождается выделением энергии, идущей на создание междоузельно-вакансионной пары (рекомбинационностимулированная генерация точечного дефекта [2–4]).

91



**Рис. 1.** Спаренный междоузельный (I) и вакансионный (V) дислокационные диски. Стрелкой показан переход атома из кристаллического состояния v в дефектное состояние i, при котором радиус петли увеличивается на размер ячейки a.

Повторение процессов локализации электрон-дырочных пар вблизи порожденных дефектов, их последующая рекомбинация с выделением энергии и генерация новых междоузельно-вакансионных пар приводят к образованию пары междоузельного и вакансионного дисков (рис. 1). Предположим, что такая пара образовалась и рассмотрим ее рост благодаря элементарным актам перехода атома с радиуса вакансионного диска v (из ядра дислокации вычитания) в состояние i, лежащее на радиусе междоузельного диска (в ядре дислокации вендрения) (рис. 1). Поскольку в исходном состоянии v атом находится в сжатой области, а в состоянии *i* (рис. 1) — в расширенной области, то энергия его в состоянии *i* выше энергии в состоянии *v* (рис. 2). Благодаря рекомбинации локализованной электрон-дырочной пары, атом при переходе  $v \to i$ преодолевает барьер  $E_v - E_{exc}$  (сплошная стрелка, рис. 2), где  $E_v$  исходная энергия активации перехода  $v \to i, E_{exc}$  — энергия, выделяющаяся при рекомбинации (рекомбинационно-стимулированный переход *v* → *i*). Поскольку концентрация локализованных электрон-дырочных пар в окрестности і-состояния гораздо ниже, чем в окрестности



**Рис. 2.** Энергетическая диаграмма атомных переходов между кристаллическим состоянием v и дефектным состоянием i.

*v*-состояния (см. ниже), мы пренебрегаем вкладом рекомбинационностимулированных переходов  $i \to v$  и считаем, что при обратном переходе  $i \to v$  атом преодолевает барьер  $E_i$  (пунктирная стрелка, рис. 2). Мы предполагаем, что  $E_v > E_i$ , но  $E_v - E_{exc} < E_i$ .

Поскольку область кристалла в окрестности *i*-состояния (на радиусе междоузельного диска) расширена [5], то в этой области ширина запрещенной зоны (переход  $\Gamma \rightarrow x$ ) увеличена, а коэффициент оптического поглощения соответственно уменьшен по сравнению с бездефектным кристаллом [5]. С другой стороны, область кристалла в окрестности v-состояния (на ридиусе вакансионного диска) сжата [5], ширина запрещенной зоны уменьшена, а коэффициент оптического поглощения соответственно увеличен. Таким образом, скорость генерации электронов и дырок за счет лазерно-индуцированных межзонных переходов будет больше в окрестности *v*-состояния, чем в окрестности *i*-состояния. Поэтому в области v будет больше скорость локализации электрондырочных пар и соответственно больше концентрация локализованных электрон-дырочных пар. Поэтому, а также благодаря тому, что  $E_v - E_{exc} < E_i$ , скорость переходов  $v \rightarrow i$  будет больше скорости обратных переходов  $i \rightarrow v$ . Это приводит к росту образовавшихся спаренных междоузельно-вакансионных дислокационных дисков в течение лазерного импульса (рис. 2).

3. Мы будем предполагать, что переходы  $v \leftrightarrow i$  совершаются только с окружностей радиуса R, где R = R(t) — радиус междоузельно-

вакансионных дислокационных дисков V и I (рис. 1). Пусть  $n_v$ ,  $n_i$  — число атомов соответственно на окружностях V и I. Кинетическое уравнение для  $n_v$  при условии  $\exp(E_{exc}/k_BT) \gg 1$  имеет вид

$$\frac{\partial n_{v}}{\partial t} = -\gamma_{v}n_{v} + \gamma_{i}n_{i}, \quad \gamma_{v} = \gamma_{v0}\frac{n_{s}}{n}, \quad \gamma_{v0} = \frac{1}{\tau}\exp\left(-\frac{E_{v} - E_{exc}}{k_{B}T}\right), \quad (1)$$
$$\gamma_{i} = \frac{1}{\tau}\exp\left(-\frac{E_{i}}{k_{B}T}\right). \quad (2)$$

Здесь  $\tau^{-1}$  — константа скорости переходов, n — концентрация атомов в кристалле,  $n_s$  — концентрация локализованных электрондырочных пар:

$$n_s = BI_L, \tag{3}$$

B — коэффициент, характеризующий эффективность генерации и локализации электрон-дырочных пар,  $I_L$  — интенсивность лазерного излучения. При записи (3) предполагается, что локализация электрондырочных пар происходит за время  $\tau_{loc} \ll \tau_p$  — длительности лазерного импульса (подробнее см. [6]).

С учетом (3) для среднего времени перехода  $v \to i$ , при котором радиус петли R возрастает на величину, равную размеру постоянной кристаллической ячейки a, имеем

$$\gamma_v^{-1} = \gamma_{v0}^{-1} \frac{I_0}{I_L}, \qquad I_0 = n/B.$$
 (4)

Предполагая в соответствии с обсуждением п. 2, что  $\gamma_i \ll \gamma_v$ , получаем с помощью (4) для скорости роста дислокационной петли во время облучения как функции интенсивности лазерного излучения и температуры следующее выражение:

$$\frac{dR}{dt} = v_g = \gamma_v a = \frac{a}{\tau} \frac{I_L}{I_0} \exp\left(-\frac{E_v - E_{\exp}}{k_B T}\right).$$
(5)

Здесь  $T = T_0 + \Delta T$ , где  $T_0$  — начальная температура,  $\Delta T$  — приращение температуры благодаря лазерному нагреву. Таким образом, при достаточно малой интенсивности накачки, когда  $\Delta T \ll T_0$ , скорость  $v_g$  линейно растет с ростом лазерной интенсивности  $I_L$  и активационным образом зависит от начальной температуры  $T_0$ . При достаточно

При  $I_L/I_0 = n_s/n \sim 10^{-2}$ ,  $a = 3 \cdot 10^{-10}$  m,  $\tau^{-1} = 10^{13}$  s<sup>-1</sup>,  $E_v - E_{exc} \sim 1.6 \cdot 10^{-19}$  J,  $T \sim 1500$  К имеем  $v_g \sim 1.3 \cdot 10^{-2}$  m/s.

После окончания лазерного импульса  $(I_L = 0, n_s = 0)$  локализованные электронные возбуждения в окрестности v-состояния отсутствуют  $(E_{exc} = 0)$  и скорость перехода  $i \rightarrow v$  (пунктирная стрелка, рис. 2) становятся больше скорости обратного перехода  $v \rightarrow i$  (поскольку  $E_i < E_v$ ). В результате радиус дислокационной петли после окончания лазерного импульса начинает уменьшаться (аннигиляция междоузельного дислокационного диска).

Учитывая (2), получаем, что уменьшение радиуса дислокационного диска происходит со скоростью  $v_r = a/\tau \cdot \exp(-E_i/k_BT)$ .

4. В работе [7] мы развили модель медленной (скорость  $\sim 10^{-2}$  m/s) волны переключения температуры, распространяющейся в твердом теле с неравновесными (лазерно-индуцированными) дефектами. В работе [8] модель [7] была использована для интерпретации эффекта медленного (скорость  $\sim 10^{-2}$  m/s) распространения импульса изменения диэлектрической постоянной в среде, возбуждаемой лазерным импульсом. При этом в качестве неравновесных дефектов в [8] рассмотрены лазерно-индуцированные дислокационные петли, механизм образования которых не рассматривался. Рассмотрение настоящей работы дает возможный механизм лазерно-индуцированной генерации и аннигиляции таких петель.

Данная работа выполнялась по гранту РФФИ 00-02-17249 (A).

## Список литературы

- [1] Ван Бюрен. Дефекты в кристаллах. М., 1962. 584 с.
- [2] Sumi H. // Phys. Rev. 1984. B 29. P. 4616–4630.
- [3] Kimerling L.C. // Solid State Electron. 1978. V. 21. P. 1391–1401.
- [4] Emel'yanov V.I., Kashkarov P.K. // Appl. Phys. 1992. A 55. P. 161–166.
- [5] Матаре Г. Электроника дефектов в полупроводниках. М., 1974. 463 с.
- [6] Емельянов В.И., Рогачева А.В. // Квантовая электроника. 1998. Т. 25. № 11. С. 1017–1022.
- [7] Emel'yanov V.I., Rogacheva A.V. // Phys. Lett. A. 2000. V. 264. P. 478-481.
- [8] Kudriavtsev E.M., Emel'yanov V.I., Rogacheva A.V. et al. // Laser Physics. 2000. V. 10. N 3. P. 1-8.